

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成22年10月28日(2010.10.28)

【公開番号】特開2008-70370(P2008-70370A)

【公開日】平成20年3月27日(2008.3.27)

【年通号数】公開・登録公報2008-012

【出願番号】特願2007-238305(P2007-238305)

【国際特許分類】

G 01 N 15/06 (2006.01)

G 01 B 11/02 (2006.01)

G 01 B 11/24 (2006.01)

G 01 N 15/02 (2006.01)

【F I】

G 01 N 15/06 C

G 01 B 11/02 Z

G 01 B 11/24 A

G 01 N 15/02 A

【手続補正書】

【提出日】平成22年9月13日(2010.9.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

流体(21)内の粒子(2)の少なくとも1つのパラメタを測定する装置(10)であつて、

該装置(10)はビーム源(1)およびビームセンサ(3)を有しており、

該装置(10)は、流体(21)に接している流体領域(22)を有しており、

前記ビーム源(1)を構成して、流体領域(22)に向かって第1方向(11)に測定ビーム(15)が放射されるようにし、

前記ビームセンサ(3)を構成して、流体領域(22)から第2方向(12)に遠ざかる反射測定ビーム(15')が検出されるようにした形式の装置において、

前記のビームセンサ(3)は、複数のセンサ素子(31, 33)を有しており、

前記の反射測定ビーム(15')を波長選択的に検出するため、相異なるセンサ素子(31, 33)のスペクトル的な感度を変えることを特徴とする、

流体内の粒子の少なくとも1つのパラメタを測定する装置(10)。

【請求項2】

前記の装置(10)は、マイクロメカニカルビームセンサ(3)を有するか、または前記のビームセンサ(3)がマイクロメカニカルセンサ素子(31, 33)を有する、

請求項1に記載の装置(10)。

【請求項3】

前記の装置(10)は、吸収素子(4)を有している、

請求項1または2に記載の装置(10)。

【請求項4】

前記の吸収素子(4)は、流体領域(22)を制限するように設けられている、

請求項3に記載の装置(10)。

【請求項 5】

前記の測定ビーム（15）は、可視の波長領域および／または近赤外領域および／また遠赤外領域に設けられている。

請求項1から4までのいずれか1項に記載の装置（10）。

【請求項 6】

各センサ素子（31，33）はそれぞれ、スペクトル的な感度を調整するための少なくとも1つのビームフィルタ（32，24）を有する、

請求項1から5までのいずれか1項に記載の装置（10）。

【請求項 7】

前記のセンサ素子（31，33）は、ビーム吸収層（37）および／またはサーモバイアル素子（36）を有する、

請求項1から6までのいずれか1項に記載の装置（10）。

【請求項 8】

流体（21）内の粒子（2）の少なくとも1つのパラメタを測定する方法において、
ビームセンサ（3）の複数のセンサ素子（31，33）の測定信号に基づいて粒子（2）
のパラメタを求めるることを特徴とする、

請求項1から7までのいずれか1項に記載の装置によって流体（21）内の粒子（2）
の少なくとも1つのパラメタを測定する方法。

【請求項 9】

前記のパラメタとして、流体（21）内の粒子サイズおよび／または粒子形状および／
または粒子タイプおよび／または粒子密度を測定する、

請求項8に記載の方法。